

ダイナミック電気化学反応装置 d-EC

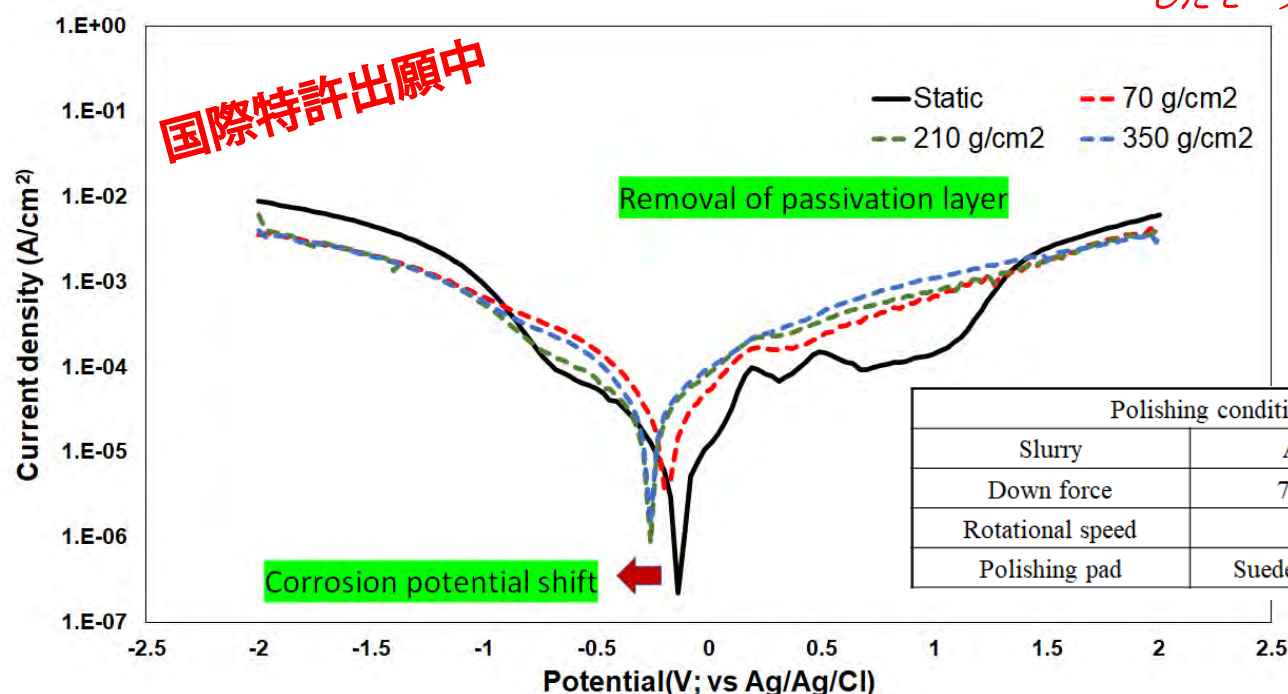
In-Situでのウエハの化学腐食反応状態を確認できる、すべてのCMP研究開発者待望の、画期的なモニタリングシステムです。



Cuウエハに作用極を装着した、スラリー容器（電解槽）



研磨パッドと電極を装着したモーターヘッド



実際に測定した、Cu基板のターフェルプロットの例（圧力を変化させて測定）



お問い合わせ先：株式会社 Doi Laboratory

福岡システムLSI開発センター 401 <http://www.doilaboratory.com>

814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3-8-33

電話 092-986-3507

E-mail : toshiro.doi.883@m.kyushu-u.ac.jp

新超精密加工プロセス技術と応用技術の提案

技術指導・企業内教育

装置・部材の販売

企業へ
橋渡し

人的ネットワークの紹介

受託加工



CMPとメッキの研究開発に必須
“ダイナミック電気化学反応 (d-EC) 装置”
好評予約受付中

革新的高性能デバイスの実現

Keywords;

- 1) 超精密加工プロセス技術
- 2) CMP (Chemical Mechanical Polishing) 技術
- 3) 難加工材料の高効率加工プロセス
- 4) ダイラタンシー現象応用加工
- 5) プラズマ融合 CMP (Plasma Fusion CMP) 技術と応用
- 6) HPMJ (High Pressure Micro-Jet) 洗浄とその応用
- 7) 研磨技術史
- 8) その他 (ウエハボンディング、MEMS, ファインバブル水応用、 $\text{MnO}_2/\text{Mn}_2\text{O}_3$ 砥粒の応用 etc.)



株式会社 Doi Laboratory



代表取締役 土肥俊郎

九州大学 名誉教授 埼玉大学 名誉教授 理化学研究所 客員研究員
大連理工大学・浙江工業大学 客員教授

<http://www.doilaboratory.com>

福岡システム LSI 開発センター 401

福岡県福岡市早良区百道浜 3-8-33

〒814-0001 電話 (092) 986-3507

E-mail: toshiro.doi.883@m.kyushu-u.ac.jp



◎ 福岡空港 / 博多駅から地下鉄で藤崎駅で下車⇒Taxi (5分)

◎ JR 博多駅 (博多口バスターミナル) から福岡タワー方面に乗車して
「福岡タワー南口」下車 (10秒)